

ナノ構造解析グループ装置利用料金表 (NIMS内部)

2020.11.09

装置名	利用形態	課金単位 (機器利用・技術補助)	利用料金 (1hあたり) 税別				
			機器利用	技術補助	技術代行1	技術代行2	技術代行3
実動環境対応物理分析電子顕微鏡 JEM-ARM200F-G	機器利用・技術補助 技術代行・共同研究	セッション(3.5h)	4,000	6,100	6,310	8,200	10,300
実動環境対応電子線ホログラフィー電子顕微鏡 JEM-ARM200F-B	機器利用・技術補助 技術代行・共同研究	セッション(3.5h)	4,000	6,100	6,310	8,200	10,300
300kV電界放出形透過電子顕微鏡 Tecnai G2 F30	機器利用・技術補助 技術代行・共同研究	セッション(3.5h)	3,000	5,100	5,310	7,200	9,300
200kV電界放出形透過電子顕微鏡 JEM-2100F1, JEM-2100F2	機器利用・技術補助 技術代行・共同研究	セッション(3.5h)	2,000	4,100	4,310	6,200	8,300
200kV透過電子顕微鏡 JEM-2100	機器利用・技術補助 技術代行・共同研究	セッション(3.5h)	1,000	3,100	3,310	5,200	7,300
走査電子顕微鏡 JSM-7000F	機器利用・技術補助 技術代行・共同研究	セッション(3.5h)	1,000	3,100	3,310	5,200	7,300
デュアルビーム加工観察装置 NB5000	機器利用・技術補助 技術代行・共同研究	セッション(3.5h)	3,000	5,100	5,310	7,200	9,300
FIB加工装置 JIB-4000, JEM-9320FIB	機器利用・技術補助 技術代行・共同研究	セッション(3.5h)	1,000	3,100	3,310	5,200	7,300
FIB加工装置 ピックアップシステム	機器利用・技術補助 技術代行・共同研究	時間(0.25h)	1,000	3,100	3,310	5,200	7,300
ウルトラマイクローム Leica EM UC6	技術補助・技術代行 共同研究	時間(1h)	—	3,100	3,310	5,200	7,300
HRTEM解析システム	技術補助・技術代行 共同研究	時間(1h)	—	3,100	3,310	5,200	7,300
電子線トモグラフィー解析システム	技術補助・技術代行 共同研究	時間(1h)	—	3,100	3,310	5,200	7,300
TEM試料作製装置群	機器利用・技術補助 技術代行・共同研究	時間(1h)	1,000	3,100	3,310	5,200	7,300

その他の支援	利用形態	課金単位	利用料金 (1hあたり) 税別
解析	技術代行	時間(0.25h)	2,100
技術指導料	技術補助	時間(0.25h)	2,100

※お支払いの所管(配算体)にかかわらず消費税が加算されます
 ※技術代行の料金設定は、難易度によって3種類に分かれています
 標準的な作業の場合は2が適用されます